

Technical-News

高分解能 TEM による界面の観察

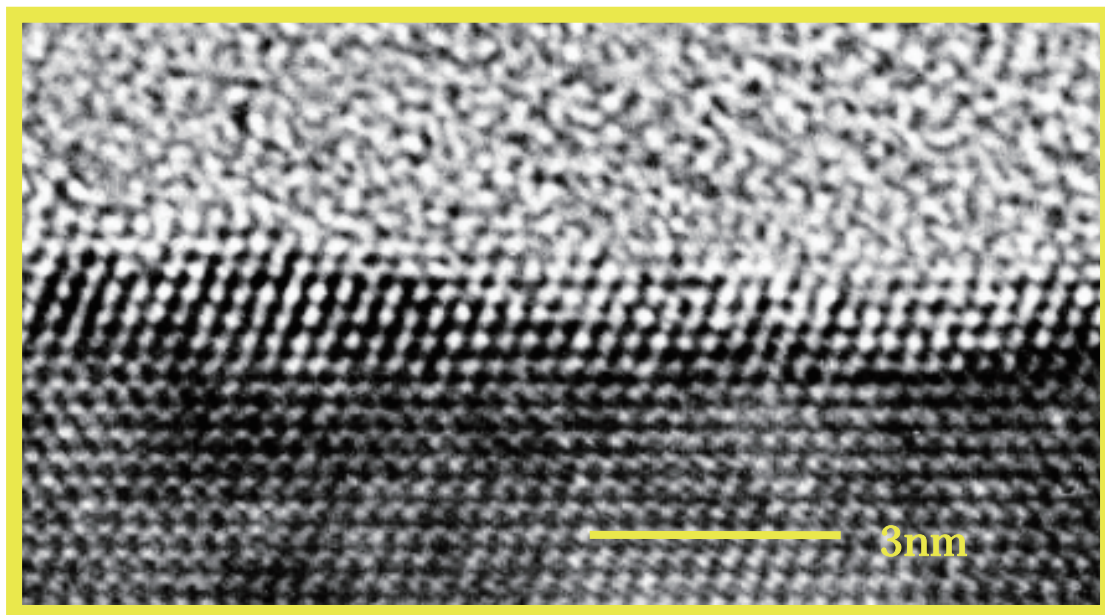
TEM-02

株式会社イオンテクノセンター

材料評価にはナノスケールのレベルで構造を観察できる高分解能透過型電子顕微鏡 (HR-TEM) が不可欠です。

ここではシリコン基板とアモルファス膜の界面を高分解能 TEM (JEOL-4000EX) により観察した例を紹介します。電子ビーム入射方向を[110]に設定することによって基板の構造を格子像レベルで観察することができており、基板面は(111)面であることがわかります。さらに原子レベルで界面構造を観察することができます。

シリコン基板とアモルファス膜の界面の HR-TEM 像



お問合せ窓口

イオンテクノセンター技術営業部
E-mail: info@iontc.co.jp

TEL:072-859-6601 / FAX:072-859-5770
URL: http://www.iontc.co.jp